



3-126-0500

キップガス発生装置 LG (500mL)

標準価格(税抜)

¥41,000

(税込：¥45,100)

- 固体と液体の反応から繰り返し多量の気体を発生させる装置です。コックの開閉で発生をコントロールできます。
- 金属陽イオンの分離に使用する硫化水素や酸素・二酸化炭素の発生に使用します。
- 金属陽イオンの沈殿反応を確認するための硫化水素発生におすすめです。硫化水素発生の際はドラフト内でご使用下さい。

〔実験例〕キップガス発生装置の仕組み（硫化水素の発生）硫化水素を発生させる場合、(A)に希硫酸、(B)に小塊状の硫化鉄を入れ、コックを開くと(A)の希硫酸は(C)から(B)へ達し、硫化鉄と反応し硫化水素を発生します。

容量	約500mL
セット内容	発生装置 安全ロート 穴あきゴム栓 活栓付ガラス管

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.